

EB蒸着源 SSEBシリーズ

■ 概要

SSEBシリーズはニッケル、クロム、シリコン、金などを蒸着するための実験用蒸着源です。K-セルでは対応が難しい材料の蒸着に最適です。少量の蒸着を試したい等、簡単に導入頂けます。超高真空に対応した設計となっており、各種超高真空装置にも搭載が可能です。

■ 特徴

1. ARIOS独自の制御電源により安定な蒸着が可能です。
2. シンプルな構成により、容易にメンテナンス、試料交換を行えます。
3. 試料を棒タイプ対応にすることにより、基板フェイスアップ型装置への本体取付も可能です。
4. 真空内挿入長は装置にあわせて変更が出来ます。
5. 試料がアースとなっており、蒸着時にイオンが発生せず、ソフトな蒸着が可能です。※¹ SSEB-500N
6. 試料への高圧印可型で、フラックスモニター(イオン電流検出式)を内蔵しています。※² SSEB-500FM
7. 高電圧感電防止のためのインターロック(フィラメント通電時のみ高圧が印加可能)を装備しています。
8. 冷却水の必要がなく、設置場所に左右されません。(試料材による)
9. 制御電源は100V、200Vの選択が可能です。(工場出荷時設定)

■ 仕様 ※電源仕様は裏面を参照下さい。

項目	内容	
蒸着源型式	SSEB-500N	SSEB-500FM
電源型式	SSEB-PS01	SSEB-PS02
接続フランジ	φ114CF	
真空内挿入長	340mm (標準)	363mm (標準)
試料サイズ	φ3×20mm (ルツボ型は0.03cc)	
フラックスモニター	無し	イオン電流検出用電極搭載
試料微動調整	挿入ストローク 25mm	
シャッター機構	手動シャッター (標準)	
ベーキング温度	最高 200℃ (直線導入機部を除く)	
リーク量	6.7×10 ⁻¹¹ Pa・m ³ /sec 以下	

□ オプション

- ・自動シャッター機構 (圧空又はモーター駆動)
- ・真空内挿入長変更

■ セット構成

SSEB-500N	EB蒸着源本体、EB蒸着源制御電源 (SSEB-PS01)、ケーブル式
SSEB-500FM	EB蒸着源本体、EB蒸着源制御電源 (SSEB-PS02)、ケーブル式



※特殊仕様も承ります。ご要望に応じた設計、製作が可能です。

RH-EED
システム

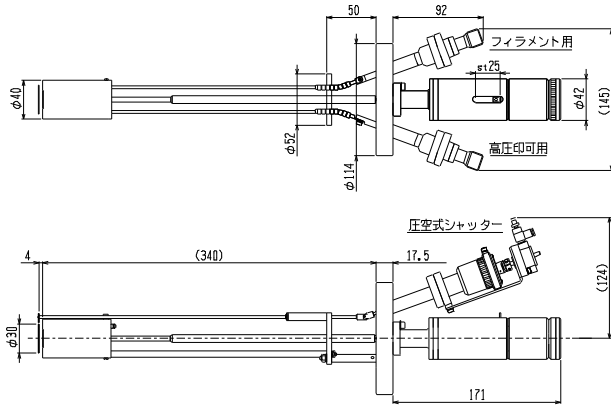
RH-EED
スクリーン

分子線セル
ユニット

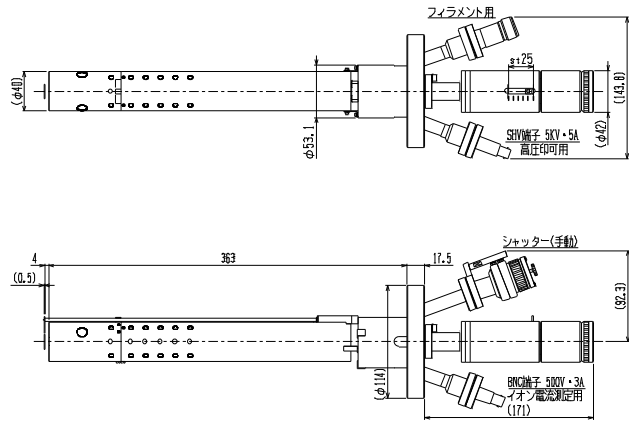
EB蒸着源

外観寸法図

SSEB-500N (圧空式シャッターオプション付)



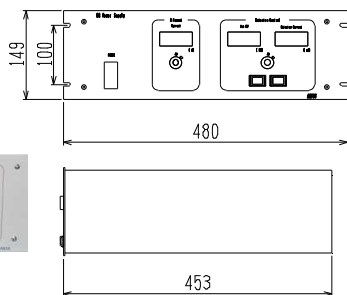
SSEB-500FM



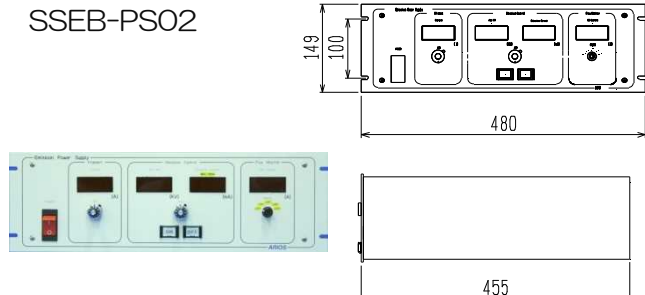
EB電源仕様

型式	SSEB-PS01	SSEB-PS02
電源入力 (工場出荷時設定)	単相 AC100V 7A または AC200V 3.5A 50/60Hz	単相 AC100V 10A または AC200V 5A 50/60Hz
最大出力電圧 (フィラメント)	10V	15V
最大出力電流 (フィラメント)	0 ~ 6.0A	0 ~ 7.0A
最大出力電圧 (加速)	0 ~ -2000V	0 ~ 2000V
最大出力電流 (加速)	0 ~ 125mA	0 ~ 125mA
フラックスモニター	無し	イオン電流検出式 検出感度 $10^{-4} \sim 10^{-8}A$
保護機能	外部構成によるインターロック フィラメント断線・未接続による高圧回路遮断 内部回路加熱によるフィラメント回路遮断	
ケーブル	出力ケーブル 5m 入力ケーブル 3m	出力ケーブル 5m (2本) 入力ケーブル 3m
パネル	JIS H150	

SSEB-PS01



SSEB-PS02



* 改良のため予告なく仕様変更することがあります。

www.arios.jp

アリオス株式会社

〒196-0021 東京都昭島市武蔵野3-2-20
TEL 042(546)4811 FAX 042(546)4814
E-mail : info@arios.co.jp

Vacuum & Plasma **ARIOS**